1 利用单摆测重力加速度

1.1 单摆模型

- 摆线不可延长
- 摆线长远远大于摆球的直径
- 摆球的质量远远大于摆线的质量

1.2 原理

当单摆拜教很小 (小于 10°) 时,可以假安卓简谐运动,其固有周期为 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$,由公式可得 $g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}$

1.3 问题

- $T^2 L$ 关系曲线不通过原点的原因
 - 摆线长度车辆误差
 - 摆角较大
 - 小球体积较大
 - 空气浮力与摩擦阻力

2 温度传感器的特性研究

热敏电阻的分类: 负温度系数 (NTC), 临界温度系数 (CTR), 正温度系数 (PTC)

2.1 传感器

• NTC 热敏电阻温度传感器

$$R_T = R_0 e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} \ (T < 450^\circ)$$

B 为热敏电阻材料系数, 在小温度范围 ($T < 450^{\circ}$) 内, B 为常数, T_0 是室温, R_0 为 $0^{\circ}C$ 时的电阻值

• PT100 铂温度传感器

$$R_T = \begin{cases} R_0(1 + AT + BT^2 + CT^3) & -200^{\circ}C < T < 0^{\circ}C \\ R_0(1 + AT + BT^2) & 0^{\circ}C < T < 850^{\circ}C \\ R_0(1 + A_1T) & 0^{\circ}C < T < 100^{\circ}C \end{cases}$$

 $A = 3.90802 \times 10^{-3} / ^{\circ}C, B = -5.80195 \times 10^{-7} / ^{\circ}C, C = -4.27350 \times 10^{-12} / ^{\circ}C, A_{1} = 3.85 \times 10^{-3} / ^{\circ}C$

$$R_0 = 100\Omega, R_100 = 138.5\Omega$$

• PN 结温度传感器

$$U = Kt + U_{qo}$$

U 为 PN 结的正向电压, t 为摄氏温度, U_{go} 为半导体材料的参数, K 为 PN 结的结电压温度

• 电流型集成温度传感器 (AD590)

$$I = Bt + I_0$$

2.2 问题

- 主要误差来源 安装不当, 绝缘变差, 热惰性, 热阻引起的误差
- NTC 热敏电阻的电流应小于 300µA 温度身高时, NTC 电阻值变小, 电流增大, 电流大于 300µA 时 m 接近电阻的最大耐受功率, 再升高电流 m 电阻会烧毁, 影响测量结果. 串联一个电阻解决问题.

3 霍尔效应

3.1 副效应

- 厄廷豪森效应
- 能斯特效应(热磁效应)
- 里纪-勒杜克效应(热磁效应产生的温差)
- 不等位效应(居首位)

副效应的消除 $V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$, 厄廷豪森副效应除外

3.2 作图

• $U_H - I_S$ $K = \frac{R_H B}{d}, U_H = K_H I_S B,$ 从而确定霍尔系数 R_H ,载流子浓度 n,霍尔灵敏度 K_H

3.3 问题

• 当外加磁场与霍尔片不垂直时, 如何获得霍尔电压与 I_S 的关系 m 以及霍尔系数等参数

比实际值偏小, 应计算磁感应强度与霍尔片之间的夹角

4 弹簧振子的研究

4.1 测量方法

胡克定律: 弹簧在外力作用下将产生形变 (即伸长或缩短). 在弹性限度内, 外力 F 和它的变形量成正比. F = -ky

伸长法测弹簧倔强系数 $mg=-ky\Rightarrow y=\frac{mg}{k}=\frac{g}{k}m$ 周期法测弹簧倔强系数 $F=-kx=ma\Rightarrow T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi\sqrt{\frac{m+pm_0}{k}}$ p 为待定系数, 柱形弹簧越 $\frac{1}{3}$, pm_0 为有效弹簧质量

4.2 问题

• 在测量任意弹簧的劲度系数时, 若实砝码盘内砝码的质量呈等差级数列, 而所测得的弹簧的伸长量并非等间隔的变化, 分析出现这种结果的原因.

弹簧的劲度系数不确定, 砝码长时间使用后质量不标准, 砝码质量超过了弹簧 的极限

5 惠斯通电桥测量中值电阻

电桥平衡时, 当闭合 K 时, G 中无电流, $U_{AB}=U_{AD},\,U_{BC}=U_{DC},\,$ 即 $I_1R_x=I_2R_4,\,I_1R_2=I_2R_3,\,$ 由此可得

$$R_x = \frac{R_2}{R_3} R_4$$

即 $R_xR_3 = R_2R_4$, 两相对桥臂电阻的乘积相等

5.1 影响电桥灵敏度的因素

- 与检流计的电流灵敏度 S_i 成正比, 但不是越大越好 (不易稳定, 不易调平衡)
- 与电源的电动势 E 成正比
- 与电源的内阻 r_E 和串联的限流电阻 R_E 有关. 增加 R_E 可降低电桥的灵敏度
- 与检流计的内阻 R_G 有关, R_G 越小越灵敏

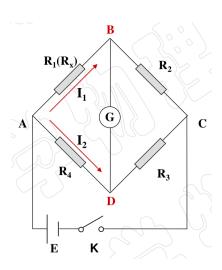


图 5.1: 惠斯通电桥结构

6 牛顿环测平面凹透镜曲率半径

光波入射到薄膜, 经薄膜上下表面反射而产生的干涉现象称为薄膜干涉.

6.1 条纹类型

等倾条纹 薄膜厚度均匀时, 光线入射在薄膜上所才产生的的干涉现象, 即同一条纹相应入射光的**同一倾角**.

等厚条纹 薄膜厚度不均匀时, 光线入射在薄膜上所才产生的干涉现象, 即同一条纹相应膜的**同一厚度**.

6.2 牛顿环

$$k$$
 级暗环 $r_k=\sqrt{k\lambda R}$
$$k$$
 级明环 $r_k=\sqrt{\frac{(2k-1)\lambda R}{2}}$ 曲率半径 R $R=\frac{(r_m^2-r_n^2)}{(m-n)\lambda}=\frac{(D_m^2-D_n^2)}{4(m-n)\lambda}$

6.3 问题

- 膜为何要薄? 光的相干长度所限
- 若牛顿环中心是亮斑而不是暗斑, 可能是什么原因造成的? 对测量结果有无影响?

可能原因时空气间隙层有人尘埃附加光程差. 对结果无影响, 附加光程差是恒定的, 可测量暗环消除误差.

7 非线性元件的伏安特性

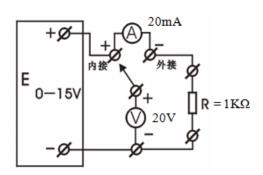


图 7.1: 电路图

8 用气垫导轨验证动量守恒定律

8.1 问题

使用气垫导轨要注意哪些问题,如何调节气垫导轨水平?保持气垫导轨表面的平直度和光洁度,滑块的类表面光洁度,应严防划伤,碰坏,实验过程中不得移动导轨的位置.

粗调和细调

- 恢复系数 e 可能小于 0 吗? 为什么? 不可能
- 牛顿第二定律推导出动量守恒定律

$$\int_{t_1}^{t_2} F_{12}dt = m_2v_2 - m_2v_{20}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} F_{21}dt = m_1v_1 - m_1v_{10}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} F_{12} + F_{21}dt = (m_2v_2 + m_1v_1) - (m_2v_{20} + m_1v_{10}) = 0$$

$$(m_2v_2 + m_1v_1) = (m_2v_{20} + m_1v_{10})$$

9 扭摆法测定刚体转动惯量

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{K}}$$

$$K = 4\pi^2 \frac{J_{\text{\scriptsize xh}}}{T_{\text{\scriptsize xh}}^2 - T_{\text{\scriptsize xh}}}$$

平行轴定理 平行轴定理能够很简易地,从刚体对于一支通过质心的直轴(质心轴)的 转动惯量,计算出刚体对平行于质心轴的另外一支直轴的转动惯量.

$$J_{Z'} = J_Z + ML^2$$

9.1 问题

• 为何要测量扭转常数 每个弹簧不一样

10 磁场的描绘

载流圆线圈

亥姆霍兹线圈 亥姆霍兹线圈由一对半径与匝数均相同的圆线圈组成, 两线圈置于平行且共轴的位置, 线圈间距正好等于其半径, 坐标原点取在两线圈中心轴连线的中央点处.

11 示波器的原理和使用

11.1 组成

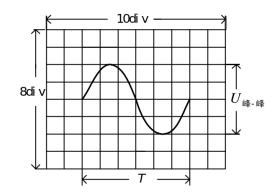
示波管 (CRT), 电子放大系统, 扫描触发系统, 电源

11.2 读数

$$U_{pp} = Y \times V/div$$

$$T = X \times T/div$$

11.2.1 例子

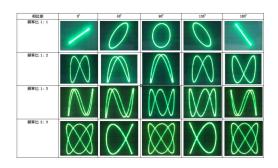


2V/div, 0.5ms/div

$$U_{pp} = 2 \times 4 = 8v$$

$$T=6\times0.5=3ms$$

11.3 李萨如图形



11.4 问题

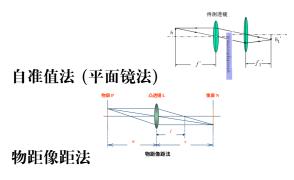
- 打开示波器电源后看不到图像的原因 亮度不够, 扫描线和光点不在显示区
- 李萨如图形抖动原因 不是整数倍

12 薄透镜焦距的测定

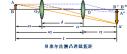
薄透镜成像公式: $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

凸透镜成像规律: $\begin{cases} u > 2f & \text{倒立缩小实像} \\ u = 2f & \text{倒立等大实像} \\ f < u < 2f & \text{倒立放大实像} \\ u < f & \text{正立放大虚像} \end{cases}$

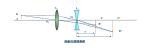
12.1 薄凸透镜焦距的测定方法



共轭法 (贝塞尔法, 二次成像法, 位移法)



12.2 凹透镜焦距的测定



13 实验

13.1 测量

直接测量, 间接测量

13.2 误差

误差是指测量值 x 与被测量的真值 x_0 之差: $\delta = x - x_0$

13.2.1 误差分类

- 系统误差
 - 仪器误差
 - 环境误差
 - 实验方法误差
 - 人员误差
- 随机误差

13.2.2 误差表现形式

- 绝对误差, $\delta = x x_0$
- 相对误差, $E = \frac{\delta}{x}$
- 引用误差 = 绝对误差/测量范围上限

13.2.3 误差处理

- 系统误差处理
 - 替代法
 - 补偿法
 - 交换法
 - 随机法
- 随机误差处理

- 随机误差的概率统计
- 随机误差的特性
- 算数平均值与标准偏差

列标准误差
$$\sigma = \lim_{n \leftarrow \infty} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - x_0)^2}{n}}$$
 子样标准差 $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ 算数平均值标准差 $S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$

13.3 不确定度

$$u_A = S_{\bar{x}}$$

$$u_B = \frac{\Delta_{\{X\}}}{\sqrt{3}}$$

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

13.4 数据处理

列表法,作图法,逐差法,最小二乘法